

Deutsche Akkreditierungsstelle

Anlage zur Akkreditierungsurkunde D-PL-22013-01-00 nach DIN EN ISO/IEC 17025:2018

Gültig ab: 15.07.2023

Ausstellungsdatum: 04.01.2024

Inhaber der Akkreditierungsurkunde:

Sony Europe B.V.
Kemperplatz 1, 10785 Berlin

Mit ihrem Prüflabor

Sony Europe B.V.
Zweigniederlassung Deutschland
Stuttgart Technology Center
Stuttgart Laboratory 2 (SL2)
Hedelfinger Straße 61, 70327 Stuttgart

Das Prüflaboratorium erfüllt die Anforderungen gemäß DIN EN ISO/IEC 17025:2018, um die in dieser Anlage aufgeführten Konformitätsbewertungstätigkeiten durchzuführen. Das Prüflaboratorium erfüllt gegebenenfalls zusätzliche gesetzliche und normative Anforderungen, einschließlich solcher in relevanten sektoralen Programmen, sofern diese nachfolgend ausdrücklich bestätigt werden.

Die Anforderungen an das Managementsystem in der DIN EN ISO/IEC 17025 sind in einer für Prüflaboratorien relevanten Sprache verfasst und stehen insgesamt in Übereinstimmung mit den Prinzipien der DIN EN ISO 9001.

Mikroskopische Untersuchungen und quantitative Analysen mittels spektroskopischer Verfahren (EDX, FT-IR) auf Schadstellen sowie Fremdstoffe an Halbleiterbauteilen

Diese Urkundenanlage gilt nur zusammen mit der schriftlich erteilten Urkunde und gibt den Stand zum Zeitpunkt des Ausstellungsdatums wieder. Der jeweils aktuelle Stand der gültigen und überwachten Akkreditierung ist der Datenbank akkreditierter Stellen der Deutschen Akkreditierungsstelle zu entnehmen (www.dakks.de)

Anlage zur Akkreditierungsurkunde D-PL-22013-01-00

Hausverfahren 1, v2.0 2022-12-01	SL2-FA-SOP-Appearance Check and Disassembly Microscopic investigation (light microscopy) and preparation of semiconductor components for failures and foreign substances (e.g. scratches, cracks and dust particles)
Hausverfahren 2, v2.0 2022-12-01	SL2-FA-SOP-FT-IR (Fourier-Transform Infrared) Spectroscopy Spectroscopic analysis (FT-IR) of semiconductor components for failures and foreign substances (e.g. scratches, cracks and organic dust particles)
Hausverfahren 3, v2.0 2022-12-01	SL2-FA-SOP-SEM (Scanning Electron Microscopy) and EDX Analysis (Energy Dispersive X-Ray Analysis) Microscopic investigation (SEM) and spectroscopic analysis (EDX) of semiconductor components for failures and foreign substances (e.g. scratches, cracks and inorganic dust particles)

Verwendete Abkürzungen:

DIN	Deutsches Institut für Normung e.V.
EN	Europäische Norm
ISO	Internationale Organisation für Normung
IEC	International Electrotechnical Commission
SL2-FA-SOP	Hausverfahren der Sony Europe B.V.